

2023年11月24日

報道関係者 各位

会社名 レーザーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 岡林 理
(コード:6920 東証プライム市場)
発表担当 取締役執行役員 三澤 祐太郎
(TEL.045-478-7111)

新製品 アクティニック EUV パターンマスク欠陥検査装置 ACTIS「A300」シリーズを発表

【概要】

この度レーザーテックは、High NA 対応のアクティニック EUV パターンマスク欠陥検査装置、ACTIS「A300」シリーズを製品化いたしました。

【内容】

半導体デバイスの高機能化、動作速度の向上、消費電力の低減を追求するためにその製造プロセスでは微細化が継続的に求められています。EUV リソグラフィを用いた半導体製造は既に量産に適用されており、当社が販売する EUV パターンマスク検査装置の ACTIS A150 はその優れた検査性能から市場で高い評価を得ております。

このたびレーザーテックは、さらなる微細化プロセスと High NA EUV リソグラフィに対応する ACTIS の次世代機、A300 シリーズを製品化しました。

A300 シリーズでは新たに設計された光学系や高輝度光源「URASHIMA」を採用し、従来の A150 シリーズと比較しても非常に高い欠陥検出性能を実現しています。

High NA リソグラフィでは XY 方向の投影倍率が異なるアナモルフィック光学系が採用され、それぞれの方向で異なる解像度が求められます。A300 シリーズは現行の NA リソグラフィ向けと High NA リソグラフィ向け、両方の EUV マスク検査に対応しています。

レーザーテックは今後も最先端半導体メーカーのご要望にお応えし、独自のソリューション開発、品質改善、生産性向上と業界の発展に貢献してまいります。

【特長】

- ・ High NA リソグラフィ用 EUV マスクの欠陥検査に対応
- ・ 現行 NA リソグラフィ用 EUV マスクの欠陥検査に対応
- ・ 高効率光学設計と「URASHIMA」光源の採用により高い生産性を実現

【用途】

- ・ EUV マスク製造工程における欠陥検査
- ・ ウェハファブにおける EUV マスクの受入検査および定期的な品質確認検査



アクティニック EUV パターンマスク欠陥検査装置 ACTIS 「A300」シリーズ

お問い合わせ先

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社 第1ソリューションセールス部 山内 勝希

TEL: 045-478-7337

E-mail: sales@lasertec.co.jp